

Objectif WLI 20X Olympus

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Produkt #91-173 **NEU** 1 In Stock

⊖ 1 ⊕ €6.190⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€6.190,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

WLI20XMRTC **Modellnummer:**

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm

Microscope Objective **Typ:**

Infinity Corrected **Art:**

Olympus

Hersteller:

Hinweis:
Designed to be used with a 180mm Tube Lens, Sold Separately

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
1.1

Länge ohne Gewinde (mm):
44.00

Max. Durchmesser (mm):
29.8

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
9.00

Vergrößerung:
20X

Numerische Apertur NA:
0.60

Auflösung (µm):
0.56

Tiefenschärfe (µm):
0.76

Arbeitsabstand (mm):
1

Feldzahl:
22

Parfokallänge (mm):
45

Abbildungstiefe (µm):
305.6

Entrance Pupil Diameter (mm):
10.80

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Kombination aus hoher numerischer Apertur und breitem Bildfeld
- Thermische Kompensation & Stabilitätsmerkmale
- Geeignet für 3D-Oberflächenmesstechnik und -profilometrie

Das fortschrittliche optische Design der unendlich korrigierten WLI-Interferometrie-Objektive von Olympus vereint eine hohe numerische Apertur mit einem breiten Bildfeld, wodurch feine Oberflächendetails über große Bereiche hinweg klar und deutlich zu erkennen sind. Jedes Objektiv verfügt über einen eingebauten Einstellring, der temperaturbedingte Fokusverschiebungen ausgleicht und so Stabilität und gleichbleibende Messgenauigkeit auch unter instabilen Umgebungsbedingungen gewährleistet. Diese Objektive sind für die Verwendung mit einer Tubuslinse mit 180 mm Brennweite konzipiert und in Vergrößerungsstufen von 10 bis 50X erhältlich. Die unendlich korrigierten WLI-Objektive von Olympus eignen sich ideal für die 3D-Oberflächenmesstechnik und Profilometrie, einschließlich Halbleiterinspektion, Präzisionsbearbeitung, Bewertung optischer Beschichtungen und mikroelektronischer Charakterisierung.